

表 1-1. 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

装置群	装置等			利用料金(一時間当り)			設置場所
	No.	機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオクス	26,620円	42,590円	53,240円	イエロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	10,650円	17,040円	21,300円	イエロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社)	7,230円	11,560円	14,450円	イエロールーム
	A4	高速マスク露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	4,110円	6,570円	8,210円	イエロールーム
	A5	両面マスクライナー	ズース・マイクロテック(株)	2,870円	4,590円	5,740円	イエロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	450円	710円	890円	イエロールーム
	A7	厚膜フォトリソスト用スピニング装置	ズース・マイクロテック(株)	1,570円	2,500円	3,130円	イエロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	800円	1,280円	1,600円	イエロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	1,020円	1,620円	2,030円	イエロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	800円	1,280円	1,600円	イエロールーム
	A11	ウエハスピ洗浄装置	(株)カナメックス	1,490円	2,380円	2,970円	イエロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	2,470円	3,950円	4,940円	イエロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SIJテクノロジー	1,090円	1,740円	2,170円	イエロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,070円	1,700円	2,130円	イエロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	35,140円	56,220円	70,280円	加工・評価室1
	A16	近接効果補正システム	GenISys(株)	930円	1,480円	1,850円	-
A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	4,350円	6,950円	8,690円	桂クリーンルーム	
A54	両面マスクアラライナ露光装置	ユニオン光学(株)	680円	1,090円	1,360円	桂クリーンルーム	
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャンオネルバ(株)	4,070円	6,510円	8,140円	加工・評価室1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	キャンオネルバ(株)	3,880円	6,200円	7,750円	加工・評価室1
	B3	電子線蒸着装置	キャンオネルバ(株)	3,200円	5,110円	6,390円	クリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	630円	1,010円	1,260円	加工・評価室1
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	6,470円	10,340円	12,930円	クリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	13,040円	20,860円	26,080円	加工・評価室1
	B7	熱酸化物	光洋サーモシステム(株)	950円	1,510円	1,890円	クリーンルーム2
	B8	深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	5,310円	8,500円	10,620円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	5,330円	8,520円	10,650円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	920円	1,460円	1,830円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオクス	3,650円	5,840円	7,300円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	4,270円	6,820円	8,530円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	2,150円	3,440円	4,300円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	3,580円	5,720円	7,150円	加工・評価室2
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	3,390円	5,420円	6,780円	加工・評価室2
	B16	紫外線ナノインプリントボンダライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	4,560円	7,290円	9,110円	イエロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	4,140円	6,620円	8,280円	イエロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	6,830円	10,930円	13,660円	加工・評価室1
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	620円	990円	1,240円	加工・評価室1
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	530円	850円	1,060円	加工・評価室1
	B21	紫外線照射装置	(株)テクビジョン	240円	380円	470円	加工・評価室1
	B22	エキシバンド装置	(株)テクビジョン	130円	200円	250円	加工・評価室1
	B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	270円	420円	530円	加工・評価室2
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	280円	440円	550円	加工・評価室2
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	250円	390円	490円	加工・評価室2
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	1,090円	1,740円	2,170円	イエロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	1,030円	1,640円	2,050円	イエロールーム	
B28	電子線蒸着装置 (2)	大阪真空機器製作所	410円	660円	820円	加工・評価室2	
B29	高性能マッフル炉	アズワン	50円	70円	90円	加工・評価室2	
B30	UVオゾンクリーナー・キュア装置	サムコ(株)	570円	900円	1,130円	クリーンルーム2	
B51	パルン成膜装置	SCS	360円	580円	720円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	510円	810円	1,010円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	330円	520円	650円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンテック(株)	4,600円	7,350円	9,190円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	180円	290円	360円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	580円	930円	1,160円	桂クリーンルーム	

表1-2. 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

装置群	装置等			利用料金(一時間当り)			設置場所
	No.	機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジー	4,860円	7,780円	9,720円	加工・評価室1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジー	6,770円	10,830円	13,540円	加工・評価室1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	2,590円	4,140円	5,170円	加工・評価室2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスルメツ	2,350円	3,760円	4,700円	加工・評価室2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	2,520円	4,030円	5,040円	加工・評価室2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	1,010円	1,620円	2,020円	加工・評価室1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	2,060円	3,300円	4,120円	加工・評価室2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	1,570円	2,500円	3,130円	加工・評価室2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	2,740円	4,380円	5,480円	加工・評価室1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	1,670円	2,670円	3,340円	クリーンルーム2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインスルメツ	1,980円	3,160円	3,950円	加工・評価室2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	1,080円	1,730円	2,160円	加工・評価室2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	1,440円	2,300円	2,880円	加工・評価室2
	C15	触針式段差計1	BRUKER	470円	740円	930円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計2	BRUKER	470円	740円	930円	加工・評価室1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	2,850円	4,560円	5,700円	加工・評価室1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	640円	1,020円	1,270円	加工・評価室1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	2,490円	3,980円	4,970円	加工・評価室1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	810円	1,290円	1,610円	加工・評価室1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	340円	540円	670円	加工・評価室1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	1,070円	1,700円	2,130円	加工・評価室2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	1,070円	1,700円	2,130円	加工・評価室2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	1,060円	1,690円	2,110円	加工・評価室2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジー	400円	630円	790円	クリーンルーム1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	360円	570円	710円	加工・評価室1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	150円	230円	290円	加工・評価室1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	360円	580円	720円	加工・評価室1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	360円	570円	710円	加工・評価室1
	C30	強誘電体特性評価システム	(株)東陽テクニカ	730円	1,160円	1,450円	加工・評価室1
	C31	接触式シート抵抗測定器	ナブソン(株)	310円	500円	620円	加工・評価室1

- 備考
- 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
 - ・タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用(標準利用負担金(タイプC)の額の50%を10円単位で四捨五入した額とする)
 - ・タイプB: 中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用及びナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用(標準利用負担金(タイプC)の額の80%を10円単位で四捨五入した額とする)
 - ・タイプC: ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用
 - 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
 - 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
 - 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
 - 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

表2. 装置等の利用負担金の上限

利用者種別	利用料(1テーマ当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生	330万円
(2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者	
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者	
上記以外の者	1,430万円

- 備考
- 上記表中の装置利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額(消費税相当額を含む)です。なお、1テーマの継続期間6ヶ月です。

表3. 技術代行における技術料

1時間当たり	3,400円
--------	--------

- 備考
- 上記表中の料金は、1時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
 - 1時間未満の技術代行及び1時間を超える技術代行に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。
 - 技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表4の基本料金を負担いただきます。

表4. 基本料金表

利用者種別	基本料金 (1人・1時間当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	500円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	800円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記 (1)～(7)に該当しない者	1,000円

備考

- 上記表中の利用料は、1時間当たりの実験室等利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに実験室等の利用時間数を乗じた金額を1人当たりの基本料金とします。
- 複数の者が実験室等を利用する場合には、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。

表5. サテライトラボ(専有部分)・セミナー室(実験室等という)の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ(専有部分)・セミナー室	168円	21円

備考

- 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。
- 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。
- 複数の実験室等を利用する場合には、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表6. 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
装置利用日の6営業日前から2営業日前まで	利用負担金の額の25%
装置利用日の4営業日前から5営業日前まで	利用負担金の額の50%
装置利用日当日から3営業日前まで	利用負担金の額の100%

備考

- キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

表7. 技術補助における技術料

1時間当たり
3,400円

備考

- 技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。
 - ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
 - ナノハブ職員との利用開始後の技術相談(なお、利用開始前の技術相談は無料です。)
 - ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
 - ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング
- 上記表中の料金は、1時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 1時間未満の技術補助及び1時間を超える技術補助に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8. 事前講習費(オペレシ費用)

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

利用者種別	事前講習費(1時間当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	1,700円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	2,720円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記 (1)～(7)に該当しない者	3,400円

備考

- 上記表中の料金は、1時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。
- 1時間未満の事前講習及び1時間を超える事前講習に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の事前講習として、算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。
- なお安全教育(初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点を伝えるもの)については無料です。
- 上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
 - 表9に示す事前講習時の装置利用負担金
 - 表4に示した基本料金
 - 事前講習に要する消耗品費

表9. 事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してします。

利用者種別	ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の装置利用負担金	ナノハブ拠点の準備する標準試料以外の試料を用いた事前講習時の装置利用負担金
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	表1(タイプA)に示した装置利用負担金の半額	表1(タイプA)に示した装置利用負担金
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	表1(タイプB)に示した装置利用負担金の半額	表1(タイプB)に示した装置利用負担金
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記 (1)～(7)に該当しない者	表1(タイプC)に示した装置利用負担金の半額	表1(タイプC)に示した装置利用負担金